

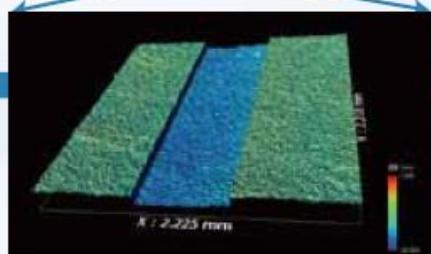
# ナノ3D光干渉計測システムによる ナノ3D計測ソリューション



## 対物レンズ影響を受けない 垂直分解能 Vertical resolution not affected by objective lens

×110

視野(Field of view)  
: 43 x 32  $\mu\text{m}$

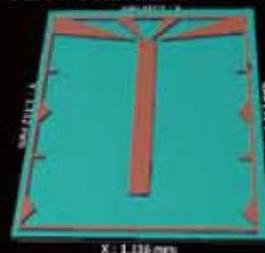


×2.5

視野 (Field of view)  
: 6436 x 6436  $\mu\text{m}$

倍率が変わっても垂直分解能は0.01 nm～  
Vertical resolution is 0.01 nm～  
even if magnification changes

VLSI standard



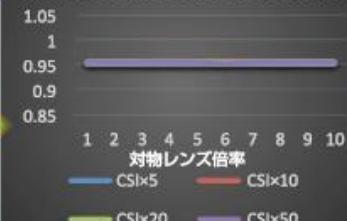
VLSI 標準段差サンプル  
0.9532  $\mu\text{m} \pm 0.0057 \mu\text{m}$  段差  
10回繰返し再現性

10 consecutive measurements using  
VLSI standard (0.9532  $\mu\text{m} \pm 0.0057 \mu\text{m}$  steps)

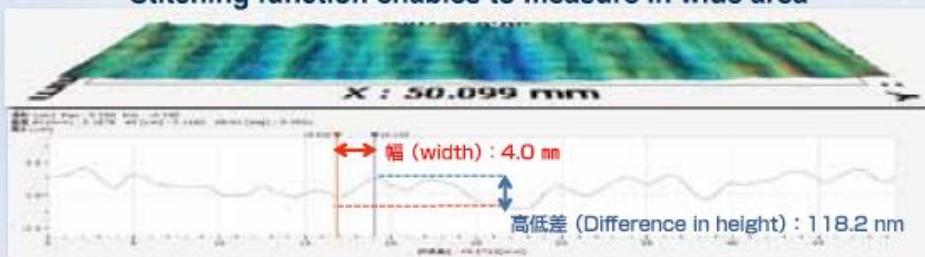
3 $\sigma$  : 1.8 nm  
高い再現性で測定可能

3 $\sigma$  : 1.8 nm  
High repeatability measurement  
is possible

VS1800 10回測定  
[ $\mu\text{m}$ ] 10 times Measurement



## 画像連結機能で より広範囲の測定が可能 Stitching function enables to measure in wide area



フィルム塗工すじムラ 視野 測定長50 mm Film coating streak unevenness Field of view Measuring length 50 mm

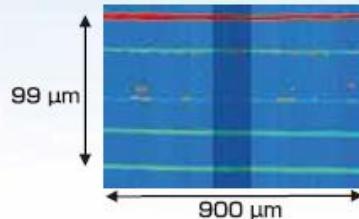
## 表面形状だけでなく、透明体層断面解析も可能 Not only topography but also layer cross section analysis of transparent sample is possible

膜厚(層断面解析)

Layer film thickness  
(Layer cross section analysis)

視野: 幅 900  $\mu\text{m}$   
(Field of view)

全体厚: 約 99  $\mu\text{m}$   
(Overall thickness)

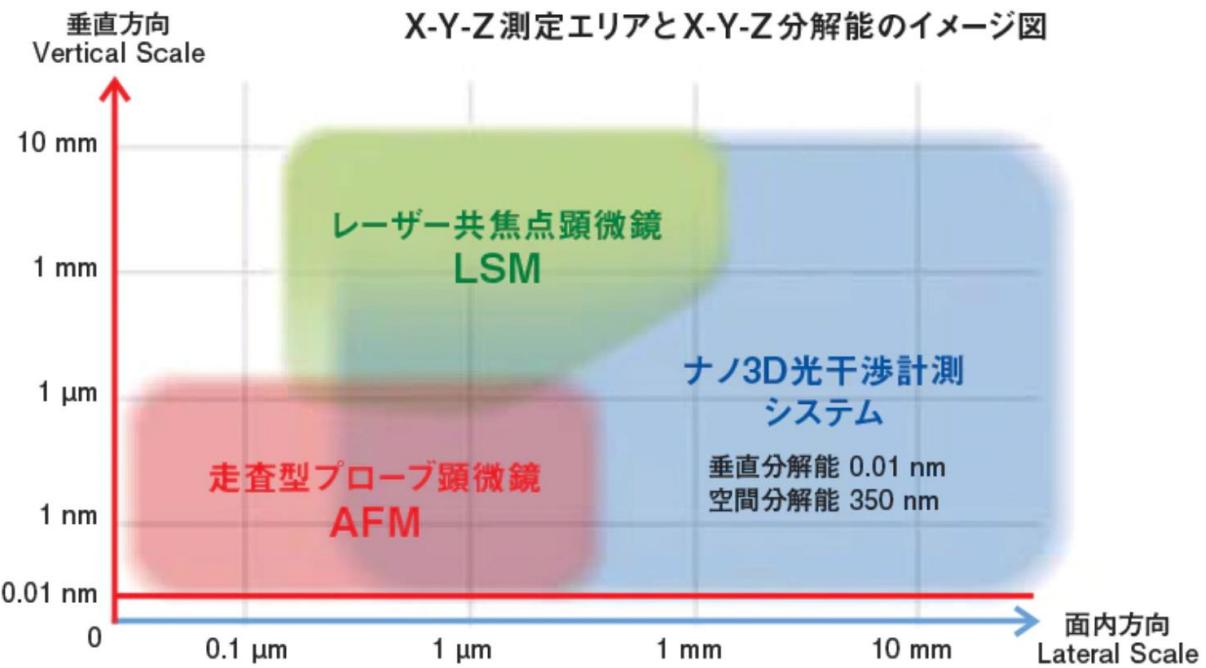


粘着層(Adhesive layer)

PET層

粘着層(Adhesive layer)

PET層  
気泡(Air bubble)



### ナノ3D光干渉計測システム VS1800の主な仕様

機種		Type 1	Type 2	Type 3		
Z軸	モーター駆動	標準搭載（最大測定Zレンジ～10 mm）				
	PZT駆動	追加オプション（最大測定Zレンジ～150 μm）				
XYステージ	駆動方式	手動	電動			
	移動領域	±50 mm	±75 mm			
ゴニオステージ	ステージサイズ	W205 × D150 mm	W225 × D225 mm			
	駆動方式	手動		電動		
測定用カメラ	移動領域	±2°	±5°			
		標準カメラ または 高画素カメラ				
鏡筒		×1 または ×0.5				
ズームレンズ		×0.7レンズ（追加オプション）				
対物レンズ		×2.5 ×5 ×10 ×20 ×50 ×110				
サンプル高さ	標準	0～50 mm				
	追加オプション	50～100 mm	0～100 mm			
	かさ上げキット使用時					



\* 仕様値はシステム構成と設置環境により異なります。

